

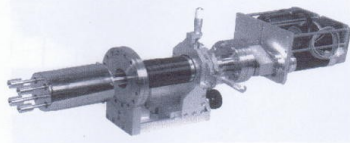
PLD用チャンバーセット [PVLD-201-LTS]

[概要] 本 PLDチャンバーセットは、応用が拡大しているレーザーアブレーションシステムにおいて小型軽量、取扱いが容易で広いニーズに対応する事を念頭において設計された基本セットでターゲット機構、レーザー光架台が含まれています。

- [特長]
1. 小型、安価ながら、拡張性に優れ、スパッタ、分子線セル等が付加する事が出来ます。
 2. 大型で特殊なレーザー窓を採用し、汚染に強く交換が容易です。
 3. チャンバー容量を小さくし短時間の排気で成膜が可能となりました。
 4. 4個収納のターゲット自公転機構が搭載され、複数の材料の成膜が可能です。
 5. シーケンサーレシピ制御により自動成膜が可能です。
 6. コンパクトなレーザー光学架台により小スペースで設置が可能です。



[チャンバー 及び 排気系]

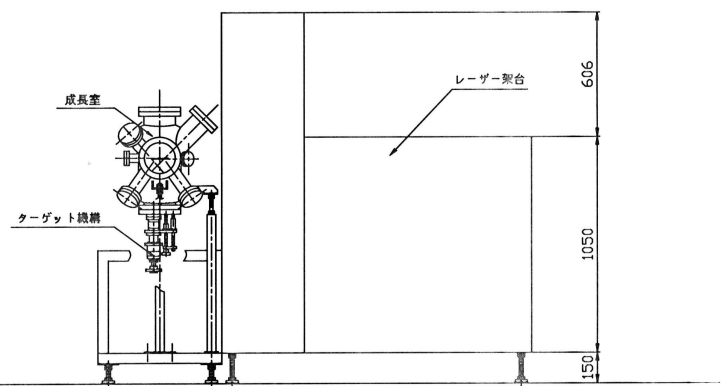
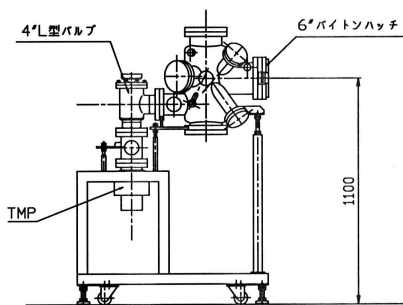
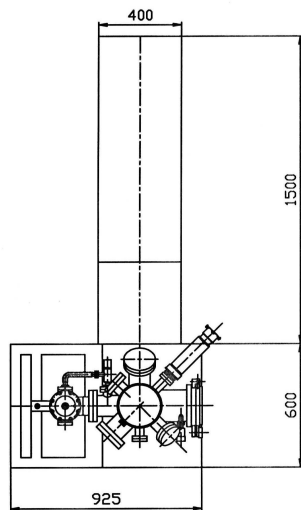


4targets rotating mechanism

[ターゲット自公転機構]



[シーケンサ制御ユニット]



[本体 及び レーザー架台]

主な仕様

項目	仕様
1. チャンバー及び排気系 チャンバー形状 レーザー導入窓 基板・ターゲット 交換ポート ポート 冷却 ポンプ ゲージ 架台	φ200x475 SUS304 水冷・電解研磨処理 152ICF 合成石英 203ICF バイトンハッチ ビューポート付き 203ICF 3個 152ICF 3個 114ICF 4個 70ICF 5個 ミニ ICF 3個 水冷 1/4”SUS304パイプ オプション オプション 600×925 L 型チャンネル鋼キャスト、アジャスター付
2. ターゲット自公転機構 ターゲット収納 自転 公転 Z動作 取付フランジ	φ20mm x 5mm 4個 AC モーター最大20rpm パルスモーター ジョグ運転 ベローズ式 最大上下 40mm 203ICF
3. レーザー架台及び光学系 形状 レーザー収納部 光学系 接続	1500×400×1650 400×1100 φ1” 45°、 22.5° ミラー及びホルダー φ1” f=500 レンズ及びホルダー チャンバー架台本体と固定
4. シーケンサー制御ユニット 形状 制御項目 ステップ数	5” タッチパネルディスプレイ レーザーパルス、シャッター開閉、ターゲット選択 20 ステップ

注) 尚性能向上のため予告なく仕様を変更する事があります。

PVR(Professional Vacuum Research)

真空機器技術コンサルティング

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-26-2

TEL・FAX：027-226-5491

E-mail： tetsuomaebashi@yahoo.co.jp